

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成24年4月26日(2012.4.26)

【公開番号】特開2011-42854(P2011-42854A)

【公開日】平成23年3月3日(2011.3.3)

【年通号数】公開・登録公報2011-009

【出願番号】特願2009-193027(P2009-193027)

【国際特許分類】

C 2 3 C	14/34	(2006.01)
C 0 1 G	23/04	(2006.01)
B 0 1 D	53/86	(2006.01)
B 0 1 J	21/06	(2006.01)
B 0 1 J	35/02	(2006.01)

【F I】

C 2 3 C	14/34	N
C 0 1 G	23/04	C
B 0 1 D	53/36	J
B 0 1 J	21/06	M
B 0 1 J	35/02	J

【手続補正書】

【提出日】平成24年2月10日(2012.2.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 4 8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 4 8】

(光触媒特性の比較2)

本発明の光触媒薄膜について、TiO₂膜厚を40nm～120nmまで段階的に変化させた、基材を準備し、上記の油分解評価法によって評価を行なった。その結果を図9に示す。